電子蓄積リング中の自己閉じ込め型不安定核イオンターゲットの R&D 研究

若杉昌徳、須田利美、矢野安重

理化学研究所 〒350-0189 埼玉県和光市広沢 2-1

概要

我々は、不安定核に対する電子散乱実験の新しい方法を提案する。低エネルギーイオンビームを電子蓄積リングに入射し、電子ビーム自身が作る横方向ポテンシャルを与えることで、イオンを3次元的に閉じ込める。これによって電子ビーム軸上に浮遊した不安定核イオンの内部ターゲット(SCRIT)を形成する。計算機シミュレーションから 10²⁷sec. ¹cm² 以上のルミノシティーが期待でき、今年度から原理実証のための R&D 研究を開始した。

1 はじめに

原子核の電荷分布、特に安定線から遠く離れた不安定 核のそれは原子核理論の構築と検証に欠かせない基本的 物理量であり、電子散乱はそのプローブとして最も優れ た方法である。不安定核の電子散乱実験には、コライダ ーを用いる方法が一般的に検討されているが、ここでは もっと簡単で安価な方法として、電子蓄積リング中に形 成する自己閉じ込め型不安定核ターゲット (Self-Confining Radioactive Ion Target: SCRIT)を用いた方法を提案する。 周回する高エネルギー電子ビーム自身が作る横方向の負 のポテンシャル井戸と外部電極を用いて与える縦方向の 静電ミラーポテンシャルが不安定核イオンを電子ビーム 軸上に閉じ込める。これが電子散乱実験のための内部タ ーゲットとなる。このアイデアは良く知られた電子蓄積 リングにおけるイオントラップ現象[1-3]と、EBIT (EBIS) [4-6]でのイオントラッピング法から発想された。厄介者 であった、イオントラッピングはターゲットとして活用 できる。図1はその概念図である。このシステムは、電 子蓄積リング、低速イオンビーム源、SCRIT 装置、およ び検出器によって構成される。SCRIT では、電子ビーム 自身がターゲットイオンを捕獲しているので、全てのイ オンが常に衝突に寄与し、コライダー法のようなタイミ ングやアライメントのコントロールを必要としない。電 子散乱実験のためには、特に重い核でルミノシティーは 10²⁶sec.¹cm² 以上必要とされる。これを検証するために計 算機シミュレーションを行った。

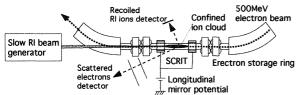


図1:SCRIT を用いた電子散乱実験スキーム

2 シミュレーション

以下の計算では、次の条件を用いた。電子ビームはエ

ネルギー E_c =500MeV、電子数 N_b =10¹⁰ 個/bunch、f=500MHz のフルバンチ運転で周回しており、バンチ長 σ_c =3cm、半径 σ_c = σ_c =1mm のガウス分布を持つ。入射するイオンは、¹³²Sn¹⁺(寿命 40sec.)で入射エネルギーは 10keV。ミラーポテンシャルは、抵抗分割されたリング電極群によって与えられ、SCRIT 長を決める。今回の計算での SCRIT 長は約 13cm である。SCRIT 付近の真空チューブは直径 5cm で、真空度は 10^{12} Torr とする。

電子ビームに捕獲されたイオンの横方向運動は、thin lens 近似を用いた電子バンチによる収束力とバンチ間のドリフトから[2,3]、

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/f \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}_0, \quad a = \frac{2N_b q r_p c}{A\sigma_x (\sigma_x + \sigma_x)}, \quad (1)$$

と表される。ここで、 r_p は古典陽子半径、A はイオンの質量数、q はイオン価数である。今回のパラメータではこの遷移行列は $|Tr| \le 2$ を満たしており、 132 Sn イオンの運動は安定な周期解を持つ。しかし、実際のトラップされ

たイオがはるようでを示すとは、刻こ果には、刻こ果に動と状にもなっての図でくっていまる。の図でくっていまで、考す程、をいいた。

図 2 (a) は、周期的に SCRIT にやって来る電子による時間に依存した負ので、電子にかられている。

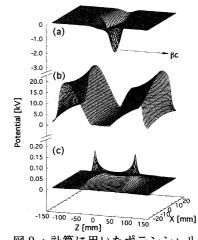


図2:計算に用いたポテンシャル

静電ポテンシャルをローレンツ変換して求める。外部から加えた縦方向静電ミラーポテンシャル(b)は、抵抗分割電極に電位を与えてポアソン方程式解いて求める。イオン雲自身による正のポテンシャル(c)は、時間的に変化するイオン分布から逐一その静電場を計算して求めた。(c)の両端のピークは、縦方向に振動しているイオンが両端で殆ど静止するために時間平均的に存在確率が高くなることによって生じる。

2.1 正電荷の蓄積限界

今回の条件でどれだけのイオンが蓄積できるのかを知るために、 132 Sn $^{1+}$ イオンの運動を調べた。簡単のために後に示す価数の増加や残留ガスの効果等はここでは考慮していない。これはイオン入射直後の短時間(<<Imsec.)では妥当である。図 3 (a)は各入射イオン数 N _{Nii}における

入射直後の残留イオン数 N_i の時間変化を示している。入射イオン数が小さければ安定して蓄積されるが、大きい場合は直ちにロスして残留イオン数は約 3×10^8 個に収束する(図 3 (b))。これは飽和電荷数 Q_L を示しており、このときの正電荷線密度は 2.3×10^7 /cm で、電子ビームの負

のポテンシャル を完全に中性化 する量の 14% に相当する。こ のやや小さい飽 和電荷数は、前 述のイオン分布 の非一様性と縦 方向ミラーポテ ンシャルの不完 全性(多少の横 方向電場成分を 持っている)に よって与えられ ることが、計算 から分かっている。

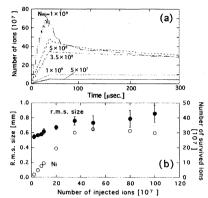


図3: ¹³²Sn¹⁺イオン数の時間変化

2.2 電子ビーム衝突による価数変化

入射後まもなく蓄積されたイオンは電子ビーム衝突によるイオン化で、次第に価数が増加する。この効果を計算に導入するために必要なイオン化断面積は、500 MeV の高エネルギー電子ビームに対して測定されていない。そこで、今回は Bethe の式[7,8]と Lotz の式[6,9]から各価数でのイオン化断面積を見積った。この場合の蓄積イオン数 N_i と平均価数 q_{av} の時間変化を図4(a)に示す。前節

で示された飽和 電荷数 Q_L を超え ない範囲では価 数が増加しても イオンの閉じ込 めは安定してい るが、超え始め ると蓄積イオン 数は減少する。 その減少率は、 入射するイオン 数と蓄積時間に 依存する。この 間のルミノシテ ィーの時間変化 が図4(b)に示さ れている。ここ で、ある時刻で のルミノシティーは

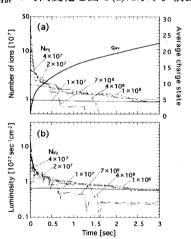


図4:電子ビーム衝突によるイオン化効果

$$L(t) = f \int_{0}^{3\sigma_{rr}} \int_{0}^{2\pi} \left\{ \left(\int_{-\infty}^{\infty} \rho_{e}(r,z) dz \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \rho_{i}(r,z,t) dz \right) \right\} r dr d\theta \qquad (2)$$

で定義されており、 $\rho_c(r,z)$ は電子バンチの密度分布で、 $\rho_c(r,z,t)$ は計算から得られた時刻 t でのイオン雲の密度分布である。ルミノシティーは入射イオン数が $10^7 < N_{inj} < 10^8$ の場合入射から 2 秒間程度は $10^{27} sec.^{-1} cm^{-2}$ 以上を維持できている。

2.3 核崩壊と残留ガス捕獲

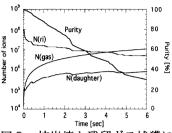


図5:核崩壊と残留ガス捕獲に伴 うイオン数と純度

下させるとともにイオンのロスを促進する。例として、図 5 は入射イオン数が $N_{m,=}10^8$ の場合の 132 Sn イオン数、娘核 132 Sb イオン数、捕獲された残留ガスイオン数および SCRIT 中での 132 Sn の純度の時間変化を示している。入射 38 Sec.後にはその純度は 60 %にまで低下する。

2.4 他の相互作用

SCRIT 中では上記以外に、残留ガスとの衝突によるイオンの中性化、イオン同士の衝突に伴う電荷とエネルギー交換、電子ビーム衝突による加熱など様々な相互作用が予想される。これらの効果を今回の計算に導入するのはかなり困難であるので、Penetrante[6]等が提案してEBITで通常用いられているレート方程式を解く方法を試みた。この方法は上記の残された効果を取り込んでいる。SCRITの場合はEBITと比較して電子ビームのエネルギーが3桁以上大きくしかもバンチしているので、電子ビームは平均的にDC電流として近似できると仮定し、相対論的修正を加えて計算を実行した。図6はPenetranteの方法

で解間変化ではどの で解間変力を が表したというで があるのめ がいきらが がのる がのる がのる がのる がのる でできる でできる。 でできる。 できること できる。

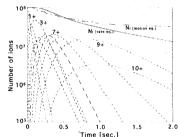


図 6 : Penetrante の方法でのイ オン数の時間変化

2.5 期待されるルミノシティー

ルミノシティーはイオン入射後時間とともに減少し、その減少率は入射イオン数に依存する。したがって、我々は最適の入射イオン数 N_{inj} と入射サイクル τ_{cycle} を見つける必要がある。 τ_{cycle} 間の時間平均ルミノシティーL を

$$L = \frac{1}{\tau} \int_{0}^{\tau_{\text{cycle}}} L(t)dt \tag{3}$$

で定義する。また、 N_{inj} は RI 生成率 N_{prod} 、入射効率 ε_{total} 、入射サイクル au_{cycle} および RI の寿命 au_{life} から

$$N_{inj} = N_{prod} \varepsilon_{total} \tau_{life} \left\{ 1 - \exp\left(-\frac{\tau_{cycle}}{\tau_{life}}\right) \right\}$$
 (4)

と書けるので、 ϵ_{max} =0.1%と仮定して、いろいろな入射サ

イクルに対して、 時間平均ルミノ シティーと時間 平均純度を N_{prod} の関数として表 すとそれぞれ図 7(a)と(b)のよう になる。この図 から、点線で示 したトレース曲 線が引けて、こ の曲線が今回の 条件での到達可 能なルミノシテ ィーと純度を示 す。例えば、 N_{mad}=10¹¹/sec.の場 合、最適入射サ イクルは τ_{cycle} =0.5

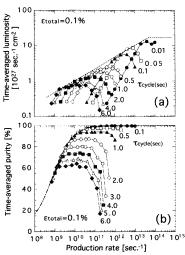


図7:時間平均ルミノシティーと 純度

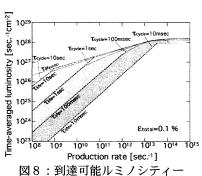
sec.で時間平均ルミノシティーは $L=2 \times 10^{27} sec.$ 1cm⁻²、時間平均純度は95%が得られる。

図7の結果をRIの寿命に対して一般化するために、 τ_{life} = ∞ のイオンに対するルミノシティー $L_{\infty}(t)$ を計算から求め、

$$L = \frac{1}{\tau_{cycle}} \int_{0}^{\tau_{cycle}} L_{\infty}(t) \exp\left(-\frac{t}{\tau_{life}}\right) dt$$
 (5)

で任意の寿命の場合の時間平均ルミノシティーを求める。 それぞれの寿命に対して図7のトレース曲線が得られ、 それらをプロットしたのが図8である。図中には、最適 な入射サイクルが点線と色の濃さによる等高線で示され

てが生お率射到ノ読図ラ率でいっ成よかサ達シみ7フのでるて率びらイ可テ取、は増大る、、入最ク能ィれ8入減けしまり、大力のではあります。



よ 図8:到達り能ルミノンティ

って左右にシフトする。

2.6 残された問題

SCRIT と蓄積されたイオン雲の存在は電子ビームに影響を与えることが予想される。SCRIT 装置によるビーム不安定性、イオン雲によるキックカはチューンシフトやエミッタンス増加を招く。我々はこれらの効果の簡単な計算を実行したが、その範囲では、電子ビーム自身の放射冷却によって十分補償できる。

図 7 、8 を見るとわかるように 10^{27} sec. $^{-1}$ cm $^{-2}$ 程度のルミノシティーを得るには低エネルギーRI 源において比較的大きな生成率を要する。この生成率を 132 Sn に対して得るために我々は、数十 kW の電子ビームで作られるBremsstrahlung X 線で UC $_2$ ターゲットを照射し、U の光核分裂を用いる方法[10-12]を検討している。

SCRIT を用いた電子散乱実験から原子核の電荷分布を

得るために散乱の運動学が決定されなければならない。そのために現在、散乱電子の角度(10-40°:運動量移項100-400MeV/cに相当)とそのエネルギー、そして同時に反跳イオンの角度(65-86°)とエネルギー(40-650keV)を必要な分解能で測定できるシステムを検討中である。

3 R&D 研究

SCRIT のアイデアを実証するために本年度より R&D 研究を始め、図9に示す SCRIT 装置を試作した。SCRIT 装置には 40 枚の抵抗分割電極群が内蔵され、任意のポテンシャル形状が形成できる。下方向は散乱電子検出のためのBe窓、上方向に反跳イオン検出器を設置する。SCRIT 装置下流側に、電子ビームの位置モニターと、イオンビーム入射用のビームラインとパルスイオン源を接続する。この装置は京都大学化学研究所の KSR に挿入する予定である。現在、理研において真空試験、イオンビーム輸送試験、および SCRIT 電極への高電圧導入と速いスイッチングによる入射と解放のための電圧変動試験を行っている。

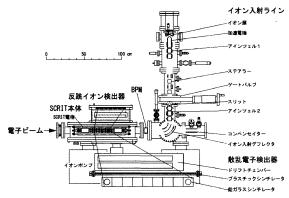


図9:SCRIT 試験装置

参考文献

- [1] L.J. Laslett, A.M. Sessler, and D. Möhl, Nucl. Instrum. Meth., 121, 517 (1974).
- [2] M.Q. Barton, Nucl. Instrum. Meth., A243, 278 (1986).
- [3] C.J. Bocchetta and A. Wrulich, Nucl. Instrum. and Meth., A278, 807 (1989).
- [4] E.D. Donets, IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, 897 (1976).
- [5] J. Arianer and C. Goldstein, IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-23, 979 (1976).
- [6] B.M. Penetrante, J.N. Bardsley, D. Dewitt, M. Clark, and D. Schneider, Phys. Rev., A43, 4861 (1991).
- [7] Von H. Bethe, Ann. Physik, 5, 325 (1930).
- [8] M. Inokuti, Rev. Mod. Phys., 43, 297 (1971).
- [9] W. Lots, Z. Phys., 206, 205 (1967).
- [10] G.D. Alton, J.R. Beene, and Y. Liu, Nucl. Instrum. Meth., A438, 190 (1999).
- [11] R.F. Welton, M.A. Janney, P.E. Müller, W.K. Ortman, R. Rauniyar, D.W. Stracener, and C.L. Williams, Proceedings of 16th Int. Conf. "Application of Accelerator in Research and Industry", p250 (2001).
- [12] W.T. Diamond, Nucl. Instrum. Meth., A432, 471 (1999).